

クロスハッチパターンの形状観察

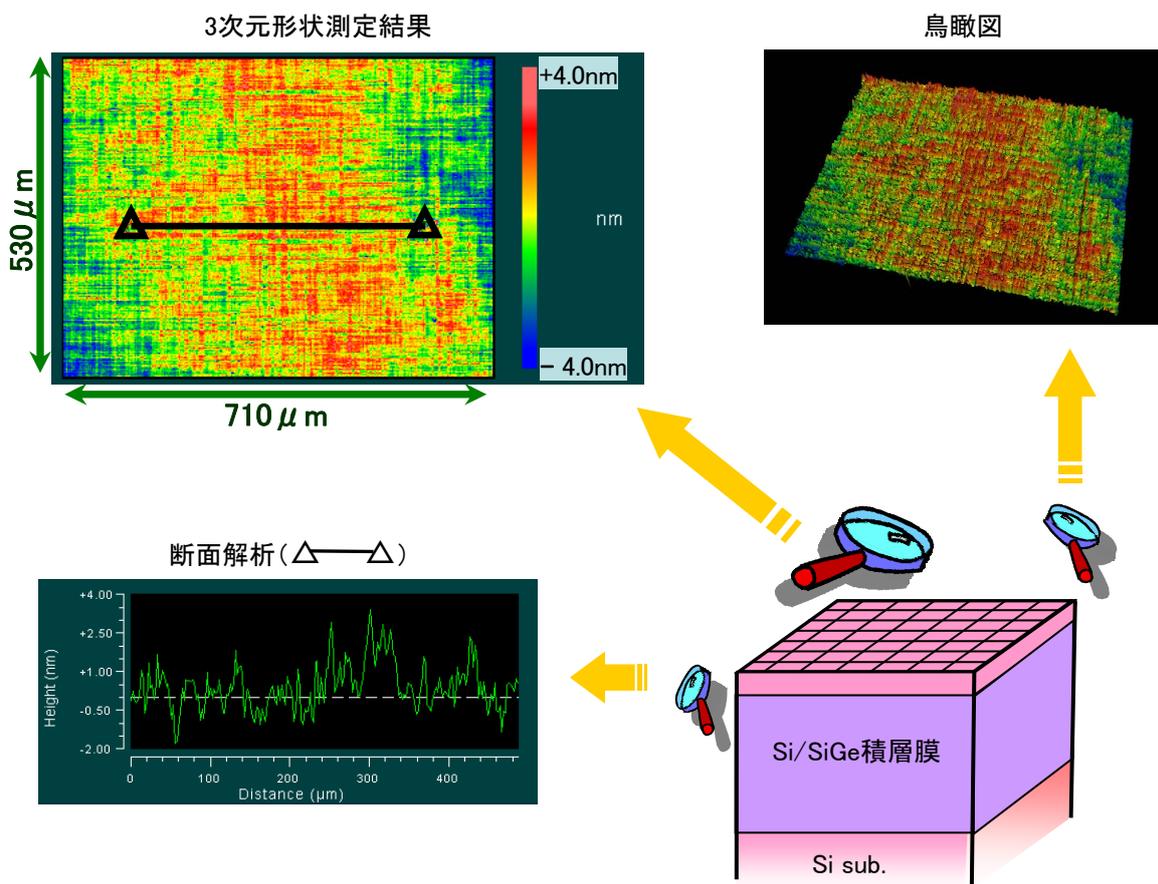
高い垂直方向分解能で小さな凹凸を可視化可能

測定法 : 白色干渉計測法
製品分野 : 電子部品
分析目的 : 形状評価

概要

走査型白色干渉計(光干渉計)は、試料の表面形状を「高い垂直(Z)分解能(0.1nm)と広い(X-Y)測定視野(50 μ m \sim 4.2mm)」で、高精度に非接触3次元測定を行うことが可能です。Si/SiGe積層試料表面(クロスハッチパターン)の形状観察の事例を紹介します。平均粗さ(Ra) \sim 1nmの形状評価可能です。

データ



サンプルご提供: 東京農工大学 大学院 工学教育部 電気電子工学専攻 須田良幸先生

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート!

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <http://www.mst.or.jp/>